

光・ナノ計測実践セミナーIV

産業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)は、「光・ナノ計測実践セミナーIV」を、2019年7月29日(月)産業技術総合研究所ナノプロセシング施設にて開催いたします。超解像観察技術、近接場光技術、共焦点技術、走査プローブ技術等を用いたナノスケールの計測・観察・評価について講師の先生に講演していただく予定です。オーサーズ・インタビューの時間を設けましたので、講師の方々に個別に質問をすることが可能です。また、実習コースでは、NPFのレーザー顕微鏡や、走査プローブ顕微鏡(SPM)を用いた観察技術について、基本的なスキルを身につけていただけるコースとなっています。奮ってのご参加をお待ちしています。

尚、実習コースに関しましては、講演会に参加されていることが条件となります。

【講演】

【日時】2019年7月29日(月)12:55-17:20

【場所】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内／申し込み】

<https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2019-1/>

【講演プログラム】

12:55-13:00 「はじめに」

産総研 共用施設ステーション 多田 哲也

13:00-13:45 「ナノオプティクスとナノ空間技術を利用したバイオセンシング」

慶應大学理工学部 斎木 敏治

13:45-14:25 「様々なマイクロスコープによるイメージング

～マイクロからナノレベルの分子へ、マイクロからミリレベルの個体、組織へ～」

産総研バイオメディカル研究部門 加藤 薫

14:25-15:05 「最先端レーザーラマン顕微鏡を用いた材料分析評価技術」

ナノフォトン(株)足立 真理子

15:05-15:25 休憩(オーサーズインタビュー)

15:25-16:05 「多光子顕微鏡技術の基礎と応用」

オリンパス(株) 玉野 真悟

16:05-16:45 「原子間力顕微鏡を利用した局所赤外分光マッピング」

産総研 分析計測標準研究部門 井藤 浩志

16:45-17:00 「ナノプロセシング施設に於けるレーザー顕微鏡と走査プローブ顕微鏡」

産総研 ナノプロセシング施設 山崎 将嗣

17:00-17:20 オーサーズインタビュー

【実習コース】

走査プローブ顕微鏡コース

日時:2019年7月30日

定員:4名

走査プローブ顕微鏡(SPM-9700)を用いて、SPM観察技術の基礎を学んで頂きます。

レーザー顕微鏡コース

日時:2019年7月31日

定員:4名

短波長レーザー顕微鏡(OLS4100)を用いて、3次元測定や液浸観察を含めて、レーザー顕微鏡のスキルを学んで頂きます。

主催:

産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設(NPF)

共催

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール tia-npf-school1@aist.go.jp

